

ART 光学素子測定装置

レンズ・プリズム・フィルム等の測定に最適

光学素子の分光透過率/反射率測定

ダブルビーム2系統補正測定により
ノイズ及び繰り返し再現性が向上

反射測定時の入射角度可変可能

独自機構により45°N偏光特性が
直接測定可能

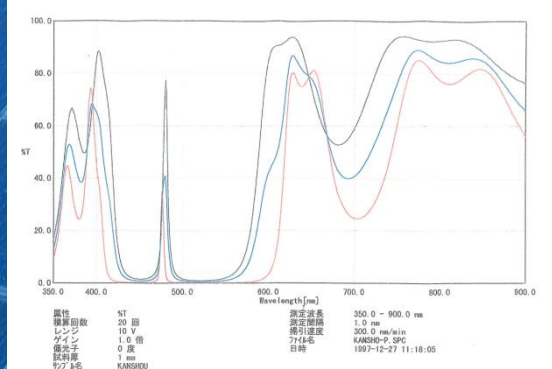
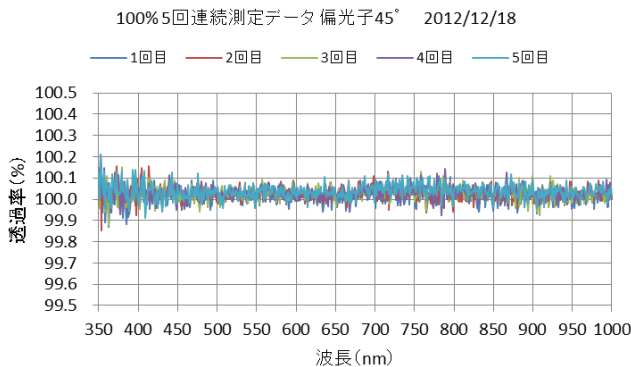
測定項目
測定方法
補正方式
波長範囲
偏光角

角度可変分光透過率 偏光測定
バックグラウンド測定方式
ダブルビーム2系統補正測定方式
300~1100nm (拡張可能)
0°・45°・90°自動設定可能

Spec

試料を入れない状態での
100%測定5階連続測定データ

干渉フィルタの透過率データ
偏光0°P/偏光45°N/偏光90°S



Data